2026 年度 KEK 真空技術及び制御技術研修（初級編）

実施要項

1. 研修の内容

加速器、半導体製造装置、医療機器など、さまざまな産業分野で活用される真空技術の基礎から実践までを体系的に学べる研修を開催します。研究者・真空技術者による実践的な講義と実習を通じて、真空の原理を理解するとともに、真空システムの設計・運用・保守に必要な知識を体系的に習得できます。真空技術と制御技術を総合的に学びたい真空初学者の皆様に適した研修です。

〈実施予定項目〉

各種真空計の使用方法、各種真空ポンプの使用方法、各種ガスケットの使用方法、真空機器の組み立て、He リークテスト、コンダクタンス計算、脱ガス測定等、インターロックシステム等（真空関係 3 日、制御関係 2 日を予定）

〈想定する真空圧力〉

大気圧(1×10^{5} Pa)から 1×10^{-7} Pa 程度

2. 実施日程

2026 年 12 月 7 日(月）～12 月 11 日(金)　：　5 日間

3. 実施場所

高エネルギー加速器研究機構（KEK）つくばキャンパス

4. 受講対象者

大学、大学共同利用機関法人及び独立行政法人に所属する技術系職員

5. 定員

3 名

実習で対応可能な人数が限られるため、定員は 3 名とします。

注. 定員を超える受講希望者があった場合は受講者の選定を行わせていただきます。
受講希望者の担当業務と講習を受ける必要の緊急性、及び申し込み順を考慮して受講者を選定いたします。受講申し込みの際、担当業務、真空技術を取得する緊急性があれば記載願います。

6. 参加料

無料

7. 旅費･宿泊費支援について

旅費・宿泊費は、受講者にて負担をお願いしておりますが、旅費・宿泊費の工面が難しいという方は、ご相談ください。

宿泊費を支給する場合の宿泊施設は基本的に KEK つくばキャンパスのドミトリーとなります。

8. 研修中のネットワーク利用

eduroam が利用できます。

9. 受講に必要な環境

インターネット（無線 LAN）接続が可能なノート PC

10. 参加申し込み先

https://conference-indico.kek.jp/event/398/

11. 申込期限

2026 年 11 月 27 日(金)まで

12. 問い合わせ先

高エネルギー加速器研究機構　技術部門
森丈晴、渡邉勇一、羽生智文、岡田俊洋
メールアドレス　　workshop4eng_office@ml.post.kek.jp

※本研修は KEK 加速器科学国際育成事業(IINAS-NX) の支援を受けて実施されます。